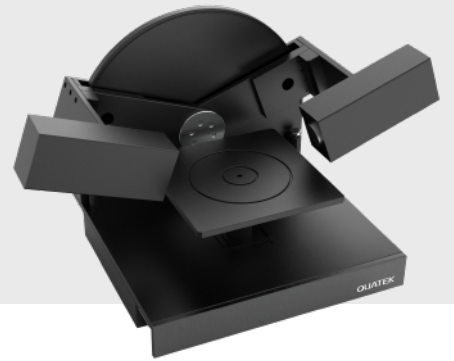


Qphoton-L

激光光谱椭偏仪



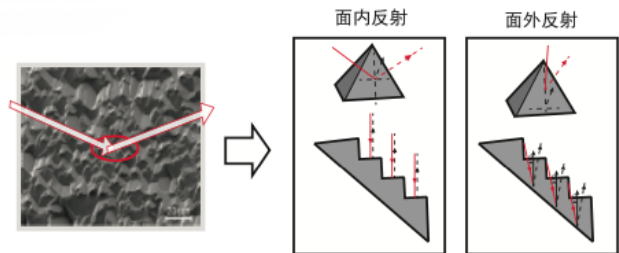
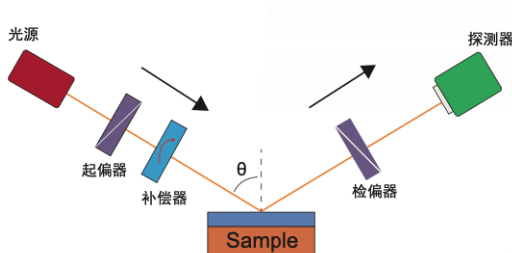
Qphoton-L为客户提供精确且经济的薄膜膜厚测量系统,针对太阳能绒面测试需求做了更贴合的设计与算法,可对纳米薄膜厚度、折射率 n 及消光系数 k 进行快速、高精度、高准确度的测量,尤其适合于工业产品和科研环境中的量产检测,新品研发,可用于表征单层纳米薄膜、多层纳米层膜厚。应用领域涉及纳米薄膜的几乎所有领域,如微电子、半导体、集成电路、显示技术、太阳电池、光学薄膜、生命科学、电化学、磁介质存储、聚合物及金属表面处理等,可同时测定:

- 多层薄膜厚度
- 折射率 n
- 消光(吸收)系数 k

产品优势

- 高稳定光源,低噪声探测
- 最大支持12寸载台或220mm 方形载台(兼容182mm方形样品)
- 多入射角度可调整,灵活性高
- 一键式软件测试,量身定制Recipe,完美契合用户需求

针对光伏行业绒面单晶硅/多晶硅电池表面减反膜测试



典型被测样品:

- a-Si
- a-C:H
- ITO
- Polysilicon
- SiO_x
- SiN_x
- AlO_x

被测衬底样品:

- Silicon
- SOI
- SOS
- GaAs
- InP
- Aluminum
- Copper
- Glass

技术规格

薄膜厚度范围:	1~2000nm
薄膜厚度精度:	SiO ₂ -100nm 标样膜厚精度0.5nm;重复性±0.2nm;折射率精度: 0.005; 重复性:±0.002
	Si/Si ₃ N ₄ /Al ₂ O ₃ 样品膜厚精度0.5nm;重复性±0.2nm;折射率精度: 0.005; 重复性:±0.002
激光波长:	635nm (其他波长可选)
光斑尺寸:	2~4mm(option:100/200um)
入射角范围:	45°~90°(手动5°步进)
载物台:	兼容 220 mm * 220mm 及以下尺寸样品
输出:	Qview软件简明显示测试结果并可上报客户系统
测量速度:	1~3秒/点
电脑:	配备Windows 10操作系统的多核处理器
尺寸:	长670*深390*高370mm
重量:	22Kg

Qview-SE 软件

界面语言:	简体中文/英文/繁体中文
权限管理:	包括管理员权限、操作员权限, 便于仪器的管理和使用
操作模式:	操作员常规一键测试; 也可支持工程人员调试Recipe与分析
结果显示:	测试批次与时间, 厚度值, 折射率, 测试时间; (可选波形分析与拟合模块功能)
文件管理:	基于Windows平台的存储, 读取等功能并支持数据上传和自动邮件 (需网络支持)

选配

硬件部分:	指定波长激光光源
	制绒面载台
	晶圆载台 (4/6/8/12 inch) 或特殊平台
	自动Mapping X/Y 平台
软体部分:	分析拟合软件波形模组
	定制特殊材料Recipe